

半導体製造ガス流量ワーキンググループ 発足のご案内

国立研究開発法人産業技術総合研究所
工学計測標準研究部門
気体流量標準研究グループ

森 岡 敏 博

背景

半導体製造プロセスにおいて、マスフローコントローラー(MFC)の**実ガス流量精度**の向上について、エンドユーザーや装置メーカーから根強い要望がある。

近年、SEMI Standardの活動として、Live Gas Task Forceを立ち上げ、実ガス流量の測定方法やMFCコンバージョンファクタの決定方法の標準化に向けたラウンドロビンテスト等を行ってきた。

SEMI Std./Live Gas Task Forceの活動は終了したが、継続して標準化活動を行っていくことを目的として、半導体製造ガス流量ワーキンググループを発足することを検討している。

*** WG準備会メンバー4名(森岡、岡部、清水、石原)**

半導体製造ガス流量ワーキンググループ説明会

日時：平成31年1月11日（金）13:00-17:00

場所：産総研臨海副都心センター別館

内容：活動方針、参加資格、会則（内規）等について

問い合わせ：森岡敏博 (tssj.morioka@aist.go.jp)